(1) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—13237

⑤ Int. Cl.³G 03 C 1/71H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 7267--2H Z 6603--5F ❸公開 昭和59年(1984) 1月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全12頁)

匈フオトレジスト組成物

②特 願 昭57-123704

22出 願

願 昭57(1982)7月14日

仰発 明 者 長田司郎

倉敷市浜ノ茶屋1丁目12-13-

2

⑩発 明 者 大塚清人

倉敷市酒津1652-1

仰発 明 者 港野尚武

茨城県鹿島郡神栖町知手3406—

23

⑩発 明 者 髙松秀雄

茨城県鹿島郡波崎町太田98

⑪出 願 人 株式会社クラレ

倉敷市酒津1621番地

個代 理 人 弁理士 本多堅

明 組 報

1. 発明の名称

フォトレジスト組成物

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ジェン単量体単位 100 あたり 0.0 1 ~ 2 0 モルのカルボキシル基または該カルボキシル基に 誘導しうる基を有する共役ジェン系重合体の環 化コム(1)と光架構剤(1)を主成分とするフォトレ ジスト組成物。
- (2) カルボキシル基または該カルボキシル基に誘導しうる基を有する共役シェン系重合体の環化ゴム(1)が、共役シェン系重合体にマレイン酸系化合物を付加した後、環化することにより得られた環化物である特許請求の範囲(1)記載の組成物
- (3) カルボキシル基または該カルボキシル基に誘導しうる基が、アクリル酸系化合物またはマレイン酸系化合物を用いることにより環化ゴムに導入された基である特許請求の範囲(1)記載の組成物。

- (4) 環化ゴム(4)が、10,000~500,000の数平均分子量を有する環化物である特許開求の範囲(1)記載の組成物。
 - (6) 光架橋剤(口が、ジアジド化合物である特許調 求の範囲(1)記載の組成物。
- 3 発明の詳細な説明

本発明は、フォトリソグラフィに好適なゴム系フォトレジスト組成物に関する。 更に詳しくは、カルボキシル基を有する共役ジェン系 重合体の環化物を用いることにより、基板に対する優れた啓着性を有する高感度ネガ型環化ゴム系フォトレジスト組成物に関する。

フォトリソグラフィ処理を利用して製造されるトランシスターやIC、LSI などの半導体素子はますまず集積回路化、つまり小型化されつつあり、今日でも最も技術画新の目ざましい分野の一つと見なされている。これにともなつて、各構成々分に対する要求性能は一段と厳しく、かつ高くなつてきている。

一般に、この種の環化ゴムの物性は、その分子

風、分子鼠分布、環化率、環化度、ミクロ構造な どによつて定まり、これらの因子がフォトレジス トの性能に大きな影響を与えるととは、扇知のと おりである。しかしながら、例えば璵化ポリイツ プレンゴムを用いたフォトレンストの場合、環化 物の分子量は高ければ高い程、フォトレジストと しての感度は高くなるが、逆に分子量が高過ぎる と現像性が悪くなり、解像度が低下するとか、環 化率が高い程、解像度は高くエッヂの切れもよい が、基板に対する密着性が低下するとかいうよう にレジスト適性を左右する多くの諸因子の中から、 ある特定の因子のみをつきつめて変化させても必 ず複数の物性が複雑に相関して影響を受け、ある 物性は向上するが、逆に他の物性低下をともなう といつた傾向が認められる。このため一義的に踏 因子を散定していくととは難しく複雑にいり組ん だ各因子間の相関を考慮しつつ、諸物性値のバラ ンスを配慮した適正範期内に条件を規定せざるを 得ない。とのととがとの種の改質研究を複雑かつ 困難なものにしている。

物(1) および光架構剤(1)を主成分とするフォトレジスト組成物において、前配環化物が、カルポキシル結に誘導しうる底を環化前の共役ジェン系取合体のジェン単数体単位100あたり0.01~20モルを有する環化ゴムであることを特徴とする、密着性が優れ、ピンホールの少ない高解像ネガ型環化ゴム系フォトレジスト組成物を提供するものである。

本発明で用いる、カルボキシル基また,は酸カルボキシル基に誘導しうる基を有する環化ゴムは、

(ここで、 Bi~4 は、各々水薬原子、アルキル基またはアリール基を表わし、それらは同じであつても、異なつていてもよい)で示される非役シエンにもとづく単位、または

とのようなフォトレジスト組成物としての必必要性能のうち、特にその重要性、向上(改善)ののお板で要性が常に主張されてきたものの一つに、基板の対するレジストの密着性がある。技術的よび、最のもしい今日においても、その要求はかわらず、もの要求はかわらず、もの要求はかわらず、も物においても密着性の向上が望まれている。とれたポリブタジエン環化物においても密着性の改良が問題とされている。

すなわち、本発明は、共役ジェン系順合体環化

(とこで、 D~12 は、各々水素原子、アルキル毎またはアリール基を表わし、それらは同じであっても、異なっていてもよい)で示される共役ジェンにもとづく単位、または

(3) 共役シェンと共重合しうる不飽和脂肪族炭化水素 または不飽和芳香族炭化水素、含窒緊脂肪族炭化水素にもとづく単位、および

(D) α, β-不飽和カルボン酸、その酸無水物またはそのエステル誘導体等の不飽和単量体にもとづく単位、を含有する重合体の環化ゴムであり、例えば(A) および/または(B) の単位にもとづく取合体、あるいは該重合体にさらに(B) の単位を有する取合体の重合生成を前記(B) の不飽和単量体の共存下に実施し、(D)にもとづく単位を共重合成分とする共重合体を得、次いで環化する方法(D)、(A) および/または(B) の単位にもとづく取合体、あるいは該取

合体にさらに(())の単位を有する 重合体に、前記(())の の不飽和単風体を付加し、次いで現化する 方法(())の または、(A)および/または(B)の単位にもとづく 電合体あるいは該重合体にさらに(())の単位を有する 重合体を現化し、次いで前記(())の不飽和単量体を 付加させる方法(())等により得られる。なかでも、 前記(())の方法によつて得られた環化物は、本発明 の所期の目的に最もよく合致する。

(A)および/または(B)の単位にもとづく共役ジェン系重合体の例としては、イソブレン、ブタジェンの現合体のあるいは共取合体、また(A)および、フェンをの単位にもと、例えばステレン、インブチレンあるいはアクリロニトリルとの共取合体を挙げることができる。とれらのなかでも、特にポリイソブレンが本発明の所期の目的にもつともよく合致するので、好ましく用いられる。

環化物の製造時の分離、精製工程はもとより、フォトレジストの現像時の条件設定が困難となる。したがつてその量は、共役ジェン系重合体のジェン単量体単位にあたり 0.0 1~2 0 モル、好ましくは、 0.1~10 モルが適当である。なお、 共役ジェン系 重合体を現化し、次いでカルポキシル基を導入する際のその量は、 環化前の共役ジェン系 重合体のシェン単量体単位 100 あたりの量で規定され、カルポキシル基を対した。 カルボキシル基に誘導しうる基を有する共役ジェン系 重合体のその量と同じ量である。

共役シェン系電合体の環化反応は、カルボキシル基等の有無により若干反応条件が異なる場合があるものの、通常のフリーデルクラフツ触媒、例えば硫酸、バラトルエンスルホン酸、三沸化ホウ素、塩化アルミニウム、四塩化スズ、四塩化チタン、塩化亜鉛、エチルアルミニウムシクロリド、トリアルキルアルミニウム/四塩化チタン、またはアルキルアルミニウムハライト/ハロゲン化炭化水素あるいはハロゲン酢酸を用いて実施するこ

(D)の不飽和単量体の例としては、アクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸メチル、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸スチル、マレイン酸、マレイン酸、マレインで、アクリル酸では、マレインでは、アクリル酸では、アクリル酸では、アクリル酸では、アクリル酸では、アクリル酸では、アクロトンながでは、アクロトンながでは、アクロトンながでは、アクロートののは、アクロートのでは、アクロートのでは、アクロートのでは、アクロートでは、アクリートでは、アクリートでは、アクリルでは、アクルでは、

カルボキシル基またはカルボキシル基に誘導し うる基を有する共役シエン系重合体において、カ ルボキシル基またはカルボキシル基に誘導しうる 基を与える(D)にもとづく 基の量は、少な過ぎると、 充分な接着改良効果が得られず、また多過ぎると、

とがてきる。

本発明において、環化ゴムの数平均分子数は、少な過ぎると、フォトレジストの現像時におけるフォトレジストの溶解性が大で残膜性が悪く、また被膜強度もよくない。一方多過ぎると高粘性および低溶解性に帰因して作業性悪化、解像度低下等がみられる。したがつてその数平均分子量は、10,000~500,000、好ましくは50,000~300,000の範囲が適当である。

本発明で用いる光架構剤としては、シアジド化合物が好ましく用いられる。その例としては、44ージアジドベンソフェノン、44ージアジドカルコン、44ージアジドジフェニル、Pーフェニレンピスアミド、24ーピスー(4ーアンドバンザル)ー3ーメチルシクロヘキサノン等が用いられる。その使用量は、少な過ぎると機能の機関にあるのなるので欠陥が出てくる場合があり、環化物100 飯量部に対して0.1~10 鎖騒部の範囲にあるのが好ましい。

本発明のフォトレジスト組成物は、環化ゴムと 光架構剤を主成分とするものであるが、他に増感 利、保存安定剤を配合するととも可能である。ま た、ハレーション防止用吸光性材料等のネガ型環 化ゴム系フォトレジスト用添加剤を配合すること ができる。前記増感剤としては、ベンゾフエノン、 アントラキノン、1,2ーナフトキノン、1,4ーナ フトキノン、2ーメチルアントラキノン、ベンズ アントロン、ピオラントロン、9-アントラアル デヒド等のカルボニル化合物、アントラセン、ク リセン等の芳香族炭化水素、ニトロベンゼン、p ージニトロペンゼン、pーニトロピフエニル、2 ーニトロフルオレン、5-ニトロアセナフテン等 のニトロ化合物、ニトロアニリン、2ークロロー 4 ーニトロアニリン、 2,6 ージクロロー 4 ーニト ロアニリン、5ーニトロー2ーアミノトルエン、 テトラシアノエチレン等の窒素化合物、ジフエニ ルジスルフィド等のイオウ化合物が挙げられる。 また、前記保存安定剤としては、ヒドロキノン。 メトキシフエノール、 p ー t ープチルカテコール

等のヒドロキシ芳香族化合物、ペンソキノン、p ートルキノン、p-キシロキノン等のキノン類、 フエニルーαーナフチルアミン、 p, p'ージフェニ ルフエニレンジアミン等のアミン類、ジラウリル チオシプロピオナート、 4.4 ーチオビス (6 - t ープチルー3ーメチルフエノール)、 2, 2 ーチオ ビス(4 - メチルー 6 - t - ブチルフエノール)、 2-(3,5-ジーtープチルー4-ヒドロキシア ニリン)、 4,6 - ビス (N - オクチルチオ) - 8 ートリアジンのようなイオウ化合物が挙げられる。 本発明のフォトレジスト組成物は、特に基板に 対し優れた密着性(接着性)を有し、従来、密着 性低下をもたらすため不適とされていた解像度向 上のための環化ゴムの高環化率化、高環化度化に よる低粘性化、分子量分布をより狭くすることに よる感度向上等の追求が可能となる。これにより、 強度等の被膜特性に優れ、ピンホールも少なく、

のを意味する(例えば、ポリイソブレンの場合には、シー、エム、シー社編、R&Dレポート&11 「感光性樹脂の合成と応用(続)」第 357頁、(1980年、シーエム、シー社発行)参照。)。

以下、実施例によつて具体的に本発明を説明するが、本発明はそれらによつて何ら限定されるものではない。

実施例1および比較例1

雞紫雰囲気下、トルエン中でイソプレン単量体を n ーブチルリチウムを用いて 6 0 ℃で重合する C とにより得られた数平均分子量 151,000 のポリイソプレンの 5 %トルエン溶液を調製し、該溶液に無水マレイン酸を添加し、加圧反応器中、焼拌下に 160 ℃で 4 時間反応させ、変性ポリイソプレンを得た。

該変性ポリイソプレンは、赤外吸収スペクトルで評価したととろ、イソプレン単量体単位 100 あたり 1.1 モルの無水マレイン付加した変性物であった。次に、該変性物を 5 %のキシレン溶液とし、P-トルエンスルホン酸触媒の存在下、90 ℃で

5 時間加熱攪拌反応し、環化物を得た。この環化物の数平均分子量は 131,000 であり、核磁気共鳴スペクトルによる構造解析の結果、その環化度は、5.1、また環化率 7 5.8 %であり、いずれも解像度に好ましい結果を与える高いものであつた。

かつ高解像度を有する、特有の優れた密着性を与

えるものとなる。なお、ことで環化率および環化

度とは、通常高分子化学においていわれているも

とのようにして得た環化物 15.0 g に光架橋削として 2,6 ービス (4 ーアシドベンザル) シクロヘキサノン 0.5 5 g 、保存安定剤として 2,2 'ーメチルー 6 ー t ー ブチルフェノール) 0.1 5 g を用い、フォトレシスト組成物のキシレン 溶液を調製した。 該溶液をシリコーン酸化膜を分けた。 該溶液をシリコーン 1,0 世紀、 200 世紀、 85~95 ℃ で 30 分間 フリベーク した。 次いで 200 Wの高圧 水銀灯を用い、 0 世紀 光 0 世紀 200 世紀 200

一方、比較のために無水マレイン酸を添加、反応させること以外は、上記と同様にしてポリイソブレンの環化物を調製した。該環化物の数平均分子量、環化度および環化率は各々、115,000、3.0 および75.0 であつた。この環化物を用い、上記と同様にしてレジスト組成物として、焼き付け、現像そしてエッチング処理に供した。

これらの 2 種のフォトレシストについて比較したところ、無水マレイシ酸付加変性ポリイソプレンの環化物を用いた場合には、環化度着性は高いのにもかかわらず、被膜の密着性は高いり、破り、大きには、現象における剣雕傾向は認められず、耐エッチング性も良好であつた。一方未変性ポリイソプレンの環化物は環化度が高いためと考えられるが、密新性が悪く、そのことによる画像不良、特に耐エッチング性が不良であつた。

実施例2

無水マレイン酸の添加制合をかえること以外は、 実施例1と調様にして、数平均分子量 173,000 環

マレイン酸を加え、160℃で5時間加圧密閉下付加反応を行なつた。ゲル部分を口温、精製後、無水マレイン酸付加量を調べたところ、■ は環化前のポリイソブレンのイソブレン単量体単位100あたり1.9 モルであつた。

このようにして得られた無水マレイン酸の付加の加水分解外型物質を開発を開かて実施例 1 と同様にしてウェハー上に塗膜形成をし、現像、エッチング処理を行なつた。密着性、画像の鮮明度、涂膜の剝離しにくさについて調べたとろ、それらは、すべて良好なものであつた。実施例 4

市販ポリイソプレンゴム(シェル化学㈱製カリフレツクス)の素練り物を用いる他は、実施例1と同一条件にて無水マレイン酸付加および環化反応を行ない、無水マレイン酸の量が環化前のポリイソプレンのイソプレン単最体単位100あたり2.05モルであり、環化度2.8、環化率74.9%の環化物を得た。

この環化物を用い、実施例1と同様にしてフォ

化度 2.9、環化率 69.2 %の環化物を調製した。該環化物 1 0 g に 2.6 ービス (4ーアジドベンザル)シクロヘキサノン 0.20 g、 2.2 ーメチレンビス (4ーメチルー6ー・・・ブチルフエノール)0.10gを加えたをアルミニウム 蒸着したシリコーン強 1 したの 2 で、3 0 分間プリベーク後、実施間ポストベークを、現像し、150~160℃で30分間ポストベークし、次いでリン酸についてみて 現像を でったの 2 で 3 0 分間で ストベーク 1 5 0 で 1 5 0 で 1 5 0 で 1 5 0 で 3 0 分間で ストベーク 1 5 0 で 1 5 0 で 1 5 0 で 3 0 分間で ストベーク 1 5 0 で 1 5 0 で 3 0 分間で ストベーク 1 5 0 で 3 0 分間で 2 5 0 で 3 0 分間で 3 0 分割を 4 0 で 5

実施例3

実施例 1 で用いたポリイソプレンをトルエンに 溶解し、p ートルエンスルポン酸触媒の存在下、 8 0 ℃で環化反応を行ない、数平均分子第 131 DBD - 階化駅 2 8 1 - 環化率 2 3 %の間化物を

131,000、 環化度 2.81、環化率 7 3 %の環化物を得た。この環化物を 4 %トルエン溶液とし、無水

ト: レジスト組成物を調製し、その性能について調べたところ、: 前記フォトレジスト組成物は、密着性改良効果により、安定な鮮明画像を与えるものであつた。

特許出願人 株式会社 ク ラ レ 代 理 人 弁埋士 本多 繁

手 続 補 正 普

昭和 57 年 9 月14日

特許庁長官者杉和夫殿

1. 事件の表示

特顧昭 57-12,5704号

- 発明の名称
 フォトレジスト組成物
- 3. 補正をする者 事件との関係 育敷市預津1 6 2 1 番地 (108) 株式会社 ク ラ レ でをNVERIX 岡 林 次 男
- 4. 代 理 人

会 敷 市 瀬 津 育 江 山 2 0 4 5 の 1 株式会社: ク ラ レ 内 電話 会敷 0864 (23) 2 2 7 1 (代表)

(6747) 作 用 北 本 多 (東京連絡先) 株式金社クラレ特許部

電話 東京 03 (277) 3 1 8 2 5 補正の対象

明和膂の「発明の辞細を説明」の欄

ン 単 景 体 単 位 1 0 0 あ た り) 1.5 モル、 環 化 度 2.9、 環 化 率 6 9.2 % の 環 化 物 」と 訂 正 す る。

6. 補正の内容

- (1) 明細審第9頁第14~16行に記載の「通常 のフリーデルクヲフツ触媒、例をは硫酸、パ ラトルエンスルホン酸、三沸化ホウ素」を 「例えば硫酸、パラトルエンスルホン酸、通 常のフリーデルクヲフツ触媒、例えば三兆化 ホウ素」と訂正する。
- (2) 同第13頁第12行に記載の「5%トルエン溶液」を「50%トルエン溶液」と訂正する。
- (3) 同第15 頁第 **日 日** 10 行に記載の「環化物を用いた場合には」を「環化物を加水分解したものを用いた場合には」と訂正する。
- (4) 同第15 頁第15 **書籍** 百行 に記載の「 現化物 は 現化度が 高いためと考えられるが 」を「 現 化物を用いると 」と 訂正する。
- (5) 同第 1 5 頁第 2 0 行~第 1 6 頁第 1 行 に 記載の「数平均分子最 1 7 3,000 環化度 2.9、環化率 6 9.2 メの環化物」を「数平均分子量 1 7 3,000 0、カルボキシル基含量 (4 ソプレ

昭和 57年 11 11

特許庁長官 若杉和夫 殿

1. 事件の表示

188 第

特顧昭 57 ~ 1 2 3 7 0 4 号

- 2. 発明の名称
- ・フォトレジスト組成物
- 3. 補正をする者 事件との関係 介敷市液液 特許出願予他 (108) 株式会社 ク ラ レ (CERTMER) 間 林 次 男
- 4. 代 理 人

会 敷 市 洒 津 附 江 田 2 0 4 5 の 1 株式会社 ク ラ レ 内 電話 倉敷 0864(23) 2 2 7 1 (代表) 円 資産 (6747) サ ル ホ 多 ・ 曜 三三王

> 株式会社クラレ特許部 電 新 東京 03 (277) 3 1 8 2

5. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄

(東京選絡先)

手 続 補 正 書

6. 補正の内容

(1) 明細審第7頁第3~8行に記載の「または・・・・・(中略)合致する」を「(A) および/または(B) の単位にもとづく 工商合体もしくは該重合体にさらに(C) の単位を有する重合体を環化し、次いで前記(C) の本飽和単量体(D) を付加させる方法(II)、と対しては(A) および/または(B) の単位にものになる方法(II) と対しては(A) および/または(B) の単位にものに(C) の単位を有する重合体に前記(D) の不飽和単量を有する重合体に前記(D) の不飽和単量を行った。なかでも、前記(II) または(IV) の方法によって得られた環化物は、本発明の所期の目的に最もよく合致する。」

全文訂正明細書

1. 1 1 1 1

- 発明の名称
 フォトレジスト組成物の製造方法
- 2. 特許請求の範囲

と訂正する。

- (1) 環化ゴムと光架橋剤を主成物とするフォトレジスト組成物を製造するにあたり、前配環化ゴムとして、ジェン単層体単位100あたり
 0.01~20モルのカルボキシル蒸または該カルボキシル茶に誘導しりる茶を有する共役ジェン系重合体の環化ゴム(1)を用いることを特徴とするフォトレジスト組成物の製造方法。
- (2) カルボキシル蒸または該カルボキシル蒸に 誘導しうる蒸を有する共役シェン系東合体の環 化ゴム(1)が、共役シェン系集合体にマレイン酸 系化合物を付加した後、環化するととにより得 られた環化物である特許請求の範囲(1)配戦の製 造方法。

(8) 現化ゴム(イ)が、 10,000~500,000の数平 均分子量を有する環化物である特許請求の範囲 (1)記載の組成物の製造方法。 昭和58年 10日13日

特許庁長官若 杉 和 夫 殿

- 1. 事件の表示
 - **特願昭57-123704号**
- 発明の名称
 フォトレジスト組成物
- 3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

倉敷市酒津1621番地

- (108) 株式会社 ク ラ レ (1888株 上 野 他 ー
- 4. 代 理 人

会 敷 市 海 津 斉 江 旧 2 0 4 5 の 1 - 株式会社 クラレ 内 性話 合敷 0864(25) 9 3 2 5 (直通)

(6747) 作 思 北 本 多 (東京連絡先)

株式会社クラレ特許部 電 断 東京 03 (277) 3 1 8 2



- 6. 補正の内容・ 別紙のとおり。
- (4) 光架橋削が、ジアジド化合物である特許請求の範囲(1)記載の組成物の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、フォトリングラフィに好適なゴム 系フォトレジスト組成物の製造方法に関する。更 に詳しくは、カルポキシル基を有する共役ジェン 系重合体の環化物を用いることにより、基板に対 する優れた密着性を有する高感度ネガ型環化ゴム 系フォトレジスト組成物を高収率、高歩留りで製造する方法に関する。

フォトリソグラフイ処理を利用して製造されるトランジスターやIC、LSIなどの半導体素子はますます集積回路化、つまり小型化されつつあり、今日でも最も技術画新の目ざましい分野の一つと見なされている。 これにともなつて、各構成々分に対する要求性能は一段と厳しく、かつ高くなつてきている。

一般に、この種の環化ゴムの物性は、その分子 量、分子量分布、環化率、環化度、ミクロ構造な どによつて定まり、これらの因子がフォトレジス

トの性能に大きな影響を与えるととは、周知のと おりである。しかしなから、例えば環化ポリイソ プレンゴムを用いたフォトレジストの場合、環化 物の分子胤は高ければ高い程、フォトレジストと しての感度は高くなるが、逆に分子量が高過ぎる と現像性が悪くなり、解像度が低下するとか、環 化率が高い程、解像度は高くエッチの切れもよい が、基板に対する密着性が低下するとかいりよう にレジスト適性を左右する多くの諸因子の中から、 ある特定の因子のみをつきつめて変化させても必 ず複数の物性が複雑に相関して影響を受け、ある 物性は向上するが、逆に他の物性低下をともなう といつた傾向が認められる。とのため一義的に賭 因子を設定していくことは難しく複雑にいり組ん だ各因子間の相関を考慮しつつ、諸物性値のバラ ンスを配慮した適正範囲内に条件を規定せざるを 得ない。このことがこの種の改質研究を複雑かつ 困難なものにしている。

このようなフォトレジスト組成物としての必要 性能のうち、特にその重要性、向上(改善)の必

したがつてフォトレシスト組成物に用いる場合、 素板への密発性等は向上するが、 剛生物除去のため 工程操作が煩雑となり、かつ生成物 女性に関する品質管理が難しく、解像度低下による性能悪化 等の問題を起こし易い。

半導体素子製造のための微細パターン形成技術に要求される後も重要な課題は、高感度、高解像 度化の追求と同時に安定品品質管理による高歩留 りの確保にあることは周知の通りである。したが つて、半導体素子製造技術に関しても、高収率、 高歩留りで一定水準の性能が確保できて、はじめ て本来の密着性等の高性能が成力を発揮すること になる。

本発明者らは、との点に留意し、鋭意検討した 結果、カルボキシル基またはカルボキシル基に誘 導しうる基を有する共役ジェン系 重合体の環化ゴムをつくり、該環化ゴムをフォトレジストに用い ることにより、高収率、高歩留りで、しかも密着 (接着)性を顕著に向上させることが可能で、か つ新たな官能光の導入という従来法と異なる手法 要性が常に主張されてきたものの一つに、基板に対するレジストの密着性がある。技術的進展の著しい今日においても、その要求はかわらず、むしろ新たな技術革新にともない、ますます他の物性と相まつた密着性の向上が望まれている。最近開発されたポリプタジエン環化物においても密着性の改良が問題とされている。

を導入したことにより、物性のバランスを大幅に変えることが可能になり、 感度および解像服等をも併せて向上させうることを見出し、 本発明を完成するに到つた。

すなわち、本発明は、環化コムおよび光架橋削を主成分とするフォトレジスト組成物を製造するにあたり、前記環化ゴムとして、ジェン系を合体のシュン単線体単位100あたり001~20時間のカルボキシル構産位100あたけでは該カルボキシル構作ができたは該カルボキシル構作ののカルボキシル構作ができたは該カルボールの少なに高いない。密着性が優れ、ビンホールの少ない高解像オカンを発性が優れ、ビンホールの少ない高解像オカンを発性が変化ゴム系フォトレジスト組成物を製造する方法を提供するものである。

本発明で用いる、カルボキシル共主たは該カルボキシル共に誘導し うる基を有する共役シェン系 重合体の現化コムは、

(A)
$$\frac{\begin{pmatrix} R_1 & R_5 & R_4 & R_5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ C & C & C & C \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} R_5 & R_5 & R_5 \\ 1 & 1 & 1 \\ R_7 & R_7 & R_5 \end{pmatrix}}$$

特開昭59-13237(9)

(ととで、R1~6は、各々水業原子、アルキル基またはアリール薬を装わし、それらは同じであつても、 異なつていてもよい)で示される共役ジェンにもとづく単位、または

(ととで、Rr ~ 12 は、各々水素原子、アルキル燕またはアリール基を表わし、それらは同じであつても、 異なつていてもよい)で示される共役ジェンにもとづく単位、または

〇共役シェンと共重合し うる不飽和脂肪族炭化水 素または不飽和芳香族炭化水素、含窒素脂肪族炭 化水素にもとづく単位、および

(D) α , β - 不飽和カルポン酸、その酸無水物またはそのエステル誘導体等の不飽和単微体にもとづく単位、 を含有する重合体の現化ゴムであり、例えば(A) および/または(B) の単位にもとづく重合体、あるいは胺π合体にさらに(C) の単位を有する重合

を来し易い。また、数平均分子量が大きく低下するために、所期の分子量の最終生成物を得るには、原料シエン系重合体の分子量を相当高く設定しなければならず、高粘性および低溶解性に起因して作業性が悪化する。

一方、(I)の方法では、付加反応行程を含まないため、上述のような不都合は生じない。またはそれらに(C)を加えたないの方法にかいて(A)かよび(B)、またはそれらに(C)を加えた系からなる共役ジェン系重合体に(D)を行加させる場合と異なり、側反応の影響はいるく、収率よくカルボキシル基またはカルボキシル共に誘導しらる基を有する共役ジェン系重合体を製造することができる。

この漁いは、共役ジェン系電合体に対して付加 反応を行なり場合には、選択的に不飽和単量体の 付加反応が起こるのに対し、共役ジェン系重合体 環化物の場合には、分子切断、架橋等の副反応が 付随して起こり易いためと考えられる。

体の重合生成を前記(D)の不飽和単量体の共存下に 実施し、ODにもとづく単位を共重合成分とする共 熏合体を得、次いで環化する方法(I)、(A)および/ または四の単位にもとづく東合体、あるいは該重 合体にさらに(C)の単位を有する重合体に、前記(D) の不飽和単量体を付加し、次いで環化する方法(II)、 またはCAおよび/またはCBの単位にもとづく頂合 体もしくは骸熏合体にさらにCOの単位を有する重 合体に前記(10)の不飽和単量体の共存下に環化する 方法冊が挙げられる。との他に例および/または (B)の単位にもとづく重合体もしくは該頂合体にさ らに(C)の単位を有する頂合体を環化し、次いで前 紀COの不能和単数体を付加させる方法でも考えら れるが、との場合には、環化物への〇の付加反応 の際に高温またはラジカル発生触媒を必要とする ため、副次的な反応を起とし、非常りが無い。す なわち、付加反応時に多量のゲルが副生するため、 精製工程に多大な労力を要するほかりでなく、ゲ ルを除去した可務部の分子制分布も大きく拡かり、 フォトレジスト組成物に用いた場合、解像度低下

したがつて、本発明においては、(!)ないし(||)の方法で得られる環化物を用いるのが好ましい。特に、(||)の方法によつて得られた環化物は、本発明の所期の目的に最もよく合致する。

(A) および/または(B) の単位にもとづく共役ジェン系重合体の例としては、イソプレン、プタジェンのの共役ジェンをあるいは共重合体、また(A) および/または(B) および(D) の単位にもとづくまたは(B) および(D) の単位にもとづくははステレン、エチレン、イソプチレンあるいはアクリロニトリルとの共軍合体を挙げるととができる。これらのの目的にもつともよく合数するので、好ましく用いられる。

(1)の不飽和単量体の例としては、アクリル酸、 メタクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エ チル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル 等のアクリル酸系化合物、マレイン酸、無水マレ イン酸、マレイン酸メチルエステル、マレイン酸メチルエステル等のマレイン酸系化合物、イタコン酸、フマール酸、クロトン酸またはメサコン酸系化合物が撮も好ましく用いられ、それらを共役ジエン系重合体と反応し、コヘク酸残素または無水コハク酸ジエステル酸基等のコハク酸誘導体残素を側鎖とするの、ルボキシル基含有共役ジエン系重合体が生成する。

カルボキシル素またはカルボキシル素に誘導し うる素を有する共役ジェン系重合体において、カ ルボキシル素またはカルボキシル素に誘導しうる 素を与える(D)にもとづく素の量は、少な過ぎると、 充分な接着改良効果が得られず、また多過ぎると、 環化物の製造時の分離、精製工程はもとより、フ オトレジストの現像時の条件設定が困難となる。 したがつてその量は、共役ジェン系重合体のジェ ン単量体単位にあたり0.01~20 モル、好ましく は、0.1~10年ルが適当である。なお、共役ジェン系重合体を選化し、次いでカルボキシル基またはカルボキシル基に誘導しりる基を導入する際のその量は、環化前の共役ジェン系重合体のジェン単量体単位100あたりの量で規定され、カルボキシル基またはカルボキシル基に誘導しりる基を有する共役ジェン系重合体のその量と同じ数である。

共役ジェン系重合体の現化反応は、カルボキシル基等の有無により若干反応条件が異たる場合があるのの、例えば硫酸、バラトル (対し) 三沸化ホウ酸、通常のフリーデルクラフツ触媒 (三沸化ホウン 強化アルミニウム、四塩化スズ、四塩化チタン、塩化亜鉛、エチルアルミニウムジクロリド、トリアルキルアルミニウム/四塩化チタン、またはアルキルアルミニウム/一切塩化チタン、またはアルキルアルミニウム/一切塩化チタン、またはアルキルアルミニウム/一切塩化チタン・はアルキャルアルミニウム/一切塩化チタン・はアルキャルアルミニウム/一切塩化チタン・はアルキャーでは、ログン酢酸を用いて実施するととができる。

本発明において、 環化ゴムの数平均分子様は、 少な過ぎると、フォトレジストの現像時における

フォトレジストの溶解性が大で残骸性が悪く、また被腹強度もよくない。一方多過ぎると高粘性をよび低溶解性に帰因して作業性悪化、解像度低下等がみられる。したがつてその数平均分子景は、10.000~500.000、好ましくは50.000~3.00.000の範囲が適当である。

本発明で用いる光架橋剤としては、シアシド化合物が好ましく用いられる。その例としては、4.4ーシアシドベンソフェノン、4.4ージアシドカルコン、4.4ージアジドジフェニル、Pーフエニレンピスアジド、2.6ーピスー(4ーアジドベンザル)-3ーメチルシクロへキサノン等が用いられる。その使用量は、少な過ぎると添加効果が小さく、一方多過ぎると、現像後の残膜率が低くなるので欠陥が出てくる場合があり、環化物100 重畳部に対して0.1~10 重畳部の範囲にあるのが好ましい。

本発明のフォトレジスト組成物は、環化ゴムと 光架橋剤を主成分とするものであるが、他に増感 剤、保存安定剤を配合することも可能である。ま

た、ハレーション防止用吸光性材料等のネガ型環 化ゴム系フォトレジスト用添加剤を配合すること ができる。前配増限剤としては、ペンソフェノン、 アントラキノン、1,2~ナフトキノン、1,4~ナ フトキノン、2-メチルアントラキノン、ベンズ アントロン、ピオラントロン、9-アントラアル デヒド等のカルポニル化合物、アントラセン、ク リセン等の芳香族炭化水素、ニトロベンセン、p ージニトロペンゼン、 p - ニトロピフエニル、 2 ーニトロフルオレン、 5 - ニトロアセナフテン部 のニトロ化合物、ニトロアニリン、2-グロロー 4-ニトロアニリン、2.6-ジクロロー4・ニト ロアニリン、5-ニトロ-2-アミノトルエン、 テトラシアノエチレン等の窒素化合物、ジフエニ ルジスルフイド等のイオウ化合物が挙げられる。 また、前配保存安定剤としては、ヒドロキノン、 メトキシフエノール、p~t~ブチルカテコール 等のヒドロキシ芳香族化合物、 ベンゾキノン、p -トルキノン、p-キシロキノン等のキノン類、 フエニルーαーナフチルアミン、 p, p´ - ジフェニ

ルフエニレンジアミン等のアミン類、ジラウリルチオジプロピオナート、 4.4 ーチオピス (6 ー t ープチルー3 ーメチルフエノール)、 2.2 ーチオピス (4 ーメチルー6 ー t ープチルフエノール)、2 ー (3.5 ージー t ープチルー4 ーヒドロキシアニリン)、4.6 ーピス (N ーオクチルチオ) - S ートリアジンのようなイオウ化合物が挙げられる。

本発明のフォトレジスト組成物は、特に基板に対し優れた密着性(接着性)を有し、従来、密着性低下をもたらすため不減とされていた解像でしたのための環化ゴムの高環化率化、高環化度化による成既向上等の追求が可能となる。とれにより、強度の被膜性に優れ、ピンホールも少なくより、強度の高解像を有する、特有の優れた密をよび環化を力をある。なお、ここで環化率および環化である。なお、ここで環化率および環化を対している。ない、近常高分子には、ポリイソブレンの場合には、シー、エム、シー社編、R&Dレポート&11「感光性樹脂の合成と応用(続)」第337頁、

環化度は3.1、また環化率75.8%であり、いずれも解像度に好ましい結果を与える高いものであった。

とのようにして得た環化物の加水分解処理物 15.09 に光架橋剤として 2,6 - ビス (4 - アシ ドペンザル)シクロヘキサノン 0.359、保存安 定剤として 2, 2 - メチレンピス (4 - メチル - 6 - t - プチルフエノール) 0.1 5 9 を用い、フォ トレジスト組成物のキシレン路液を調製した。該 溶液をシリコーン酸化膜をつけたシリコンウェハ 一上に、スピンナーを用い、腹厚10μとなるよ り、回転逾布し、85~95℃で30分間プリベ 一クした。次いで200Wの高圧水銀灯を用い、 凸版印刷製解像度テストチャートクロムマスクを 介して露光し、画像を焼き付けた。次いでキシレ ン系現像液で現像し、酢酸n-ブチルでリンス後、 150℃で30分間ポストペークし、半導体用エ ッチング剤(NH.F / HF 水溶液)にてエッチング 処理した。

一方、比較のために無水マレイン酸を添加、反

(1980年、シーエム、シー社発行)参照。)。 以下、実施例によつて具体的に本発明を説明するが、本発明はそれらによつて何ら限定されるものではない。

実施例1および比較例1

窒素雰囲気下、トルエン中でイソブレン単量体を
を n ープチルリチウムを用いて 6 0 ℃で重合する
ことにより得られた数平均分子量 1 5 1,000 のポリイソブレンの 5 5 トルエン溶液を調製し、該溶液に無水マレイン酸を添加し、加圧反応器中、複拌下に 1 6 0 ℃で 4 時間反応させ、変性ポリイソプレンを得た。

該変性ポリイソプレンは、赤外吸収スペクトルで評価したところ、イソプレン単量体単位100 あたり1.1 モルの無水マレイン酸の付加した変性物であつた。次に、該変性物を50分のキシレン溶液とし、pートルエンスルホン酸触媒の存在下、90℃で5時間加熱攪拌反応し、環化物を得た。この環化物の数平均分子量は131.000であり、核磁気共鳴スペクトルによる構造解析の結果、その

応させること以外は、上記と同様にしてポリイソ プレンの環化物を賜製した。該環化物の数平均分 子量、環化度および環化率は各々、115,000、 3.0 および75.0 であつた。この環化物を用い、 上配と同様にしてレンスト組成物として、焼き付け、現像そしてエッチング処理に供した。

とれらの2種のフォトレジストについて比較したところ、無水マレイン酸付加変性ポリイソプレンの環化物の加水分解物を用いた場合には、環化度かよび環化率が高いにもかかわらず、被膜の密着性は高く、現像した画像は鮮明左良好なものであり、現像処理以後における剝離傾向は認められず、耐エッチング性も良好であつた。一方、未変性ポリイソプレンの環化物を用いると解斎性が悪く、そのことによる画像不良、特に耐エッチング性が不良であつた。

実施例 2

無水マレイン酸の添加割合 かえること以外は、 実施例 1 と同様化して、数平均分子散 173.000 カ ルボキシル基含敵 (イソプレン単量体単位 100 あ たり) 1.5 モル、 現化度 2.9、 環化率 6 9.2 多の環化物を調製した。 該環化物 1 0 8 に 2.6 ーピス(4ーアジトベンザル) シクロヘキサノン 0.2 0 8、 2.2 ーメチレンピス(4ーメチルー6ー tープチルフエノール) 0.1 0 8 を加え、フオトレジスト 組成物溶液を調製した。 該溶液をアルミニウム蒸剤したシリコーンウエハーに膜厚 1.0 μm になるようスピナーで流布した。 9 5 ℃で、 3 0 分間プリベーク後、実施例 1 と同様に、現像し、

150~160℃で30分間ポストベークし、次い でリン酸でエッチング処理をした。

得られたレジスト被膜についてみてみたところ、ウェハーへの密着性は良好であり、現像後の画像の状態およびその耐エッチング性はともに満足すべきものであつた。

寒 施 例 3

市販ポリインプレンゴム(シェル化学(機製カリフレックス)の素練り物を用いる他は、実施例1と同一条件にて無水マレイン酸付加および環化反応を行ない、無水マレイン酸の量が環化前のボリ

イソブレンのイソブレン単量体単位1000あたり 2.05モルであり、環化度2.8、環化率74.9 乗 の環化物を得た。

この環化物を用い、実施例1と同様にしてフォトレジスト組成物を調製し、その性能について調べたところ、前記フォトレジスト組成物は、密着性改良効果により、安定な鮮明画像を与えるものであつた。

寒施例 4

実施例1と同様に重合して得られた数平均分子 最151,000のポリイソフレンの50多トルエン溶液 を調製し、該溶液に無水マレイン酸を添加、溶解 し、次いで四塩化スメを添加し、機拌下に80℃ で8.5時間反応させて変性環化物を得た。該変性 環化物は、無水マレイン酸が反応前のイソン 単最体単位100あたり0.4 モル付加したものです あものであつた。一般に高温での環化ポリイン レンへの無水マレイン酸付加反応の場合にはゲル ルが多量に側生しやすいが、上記の場合にはゲル

の刷生は少なく、反応は円滑に実施できた。・・

とのようにして得た変性類化物の加水分解処理物を用いて実施例1と同様にしてフォトルジスト組成物を調製し、その性能について調べたところ、前記フォトレジスト組成物は、良好な密瘤性を示し、安定な鮮明画像を与えるものであつた。

特許 出願人 株式会社 ク ラ レ 代 理 人 弁理士 本 多 * 堅 <Publication No. JP-A No.59-13237>
Title "Photoresist Composition"

Page 2 left lower column line 9 to page 3 right lower column line 9

The cyclized rubber of the present invention which comprises a carboxyl group or a group which can induce to the carboxyl group is a cyclized rubber of a polymer which has the followings:

(A) a unit based on a conjugated diene represented by

(in which , R_1 - R_6 each represents a hydrogen atom, an alkyl group or an aryl group and they can be the same or different from each other), or

(B) a unit based on a conjugated diene represented by

(B)
$$\begin{array}{ccc}
R_7 & R_9 \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow \\
C & & C & \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow \\
R_9 & C & R_{10} \\
R_{11} - C & R_{12}
\end{array}$$

(in which , $R_7 - R_{12}$ each represents a hydrogen atom, an alkyl group or an aryl group and they can be the same or different from each other), or

(C) a unit based on an unsaturated aliphatic hydrocarbon, an unsaturated aromatic hydrocarbon or a nitrogenous aliphatic hydrocarbon which can be copolymerized with a conjugated diene, and

(D) a unit based on an unsaturated monomer such as α , β -unsaturated carboxylic acid, an acid anhydride thereof or an ester derivative thereof.

The cyclized rubber can be obtained by the following methods for example: (I) a method of carrying out polymerization of a polymer based on a unit of (A) and/or (B), or a polymer which further has the unit of (C) in addition to the above-mentioned polymer, under coexsistance of the unsaturated monomer of (D) to obtain a copolymer which has a copolymer component of the unit based on (D), and then cyclizing the copolymer; (II) a method of adding the unsaturated monomer of (D) to a polymer based on a unit of (A) and/or (B) or to a polymer which further has the unit of (C) in addition to the above-mentioned polymer, and then cyclizing the resultant; or (III) a method of cyclizing a polymer based on a unit of (A) and/or (B) or a polymer which further has the unit of (C) in addition to the above-mentioned polymer, and then adding the unsaturated monomer of (C). Among them, a cyclized product obtained by the method (II) suits most to an object of the present invention.

As examples of the conjugated diene polymer based on a unit of (A) and/or (B), mentioned can be made of a polymer or copolymer of conjugated diene such as isoprene, butadiene, pentadiene or phenylbutadiene. As examples of the conjugated diene polymer based on a unit of (A) and/or (B) and (C), mention can be made of a copolymer of the above-mentioned conjugated diene and a substance such as styrene, α - methylstyrene, ethylene, propylene, isobutylene or acrylonitrile. Among them, polyisoprene is preferably used because it suits most to the object of the present invention.

As examples of the unsaturated monomer (D), mentioned can be made of an acrylic acid compound such as acrylic acid, methacrylic acid, methyl acrylate, ethyl acrylate, methyl methacrylate, ethyl methacrylate; maleic acid compound such as maleic acid, maleic anhydride, maleic acid methyl ester, maleic acid dimethyl ester; and itaconic acid, fumaric acid, crotonic

acid or mesaconic acid. Among them, maleic acid compound is most preferably used. When a maleic acid compound is added to the system of conjugated diene polymer, it reacts with the conjugated diene polymer to generate a conjugated diene polymer containing a carboxyl group which has, as its side chain, a succinic acid derivative residue such as succinic acid residue, succinic anhydride residue, succinic acid monoester residue or succinic acid diester residue.

In the conjugated diene polymer comprising a carboxyl group or a group which can induce a carboxyl group, if the amount of the group based on (D) which provides the carboxyl group or the group that can induce to the carboxyl group is too small, satisfactory adhesion effect cannot be obtained. If the amount is too big, not only the separation of the cyclized product at the time of production process or a purification process, but also condition setting in developing the photoresist become difficult. Accordingly, the amount is suitably 0.01 to 20 mol to the diene monomer unit of the conjugated diene polymer, and preferably is 0.1 to 10 mol thereto. At the time of cyclizing the conjugated diene polymer and subsequently introducing the carboxyl group or the group which can induce to the carboxyl group is set by the amount per 100g of diene nomomer unit of the conjugated diene polymer before its cyclization, and it is the same amount to that of the conjugated diene polymer having the carboxyl group or the group which can induce to the carboxyl group.

Cyclization reaction of the conjugated diene polymer may slightly vary depending on the presence of the group such as the carboxyl group, but the reaction can be carried out by using a general Friedel-Crafts catalyst such as sulfuric acid, para Toluylene sulfuric acid, trifluoride boric acid, aluminum chloride, tin tetrachloride, titanium tetrachloride, zinc chloride, ethyl aluminum dichloride, trialkyl aluminum/titanium tetrachloride, alkyl aluminium halite/ halogenated hydrocarbon, or halogenoacetic acid.

In the present invention, when the number average

molecular weight is too small, solubility of the photoresist at the time of its development becomes too good so that few film remains and that coating strength becomes poor. On the other hand, when the number average molecular weight is too big, disadvantages such as deteriorated workability and low resolution are caused due to high viscosity and low solubility. Accordingly, the number average molecular weight is suitably in the range of 10,000 to 500,000, and is preferably in the range of 50,000 to 300,000.